# Электрофизические свойства и низкотемпературная фотолюминесценция монокристаллов CdTe, легированных Si

© О.А. Парфенюк<sup>¶</sup>, М.И. Илащук, К.С. Уляницкий, П.М. Фочук, О.М. Стрильчук<sup>\*</sup>, С.Г. Крилюк<sup>\*</sup>, Д.В. Корбутяк<sup>\*</sup>

Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, 58012 Черновцы, Украина \* Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины, 03028 Киев, Украина

(Получена 18 апреля 2005 г. Принята к печати 18 мая 2005 г.)

Методом Бриджмена выращены монокристаллы CdTe:Si с разными концентрациями примеси Si:  $C_{Si}^0 = 2 \cdot 10^{18} - 5 \cdot 10^{19} \text{ сm}^{-3}$ . Образцы имели *n*- и *p*-типа проводимости, величина которой была в пределах  $\sigma = 2 \cdot 10^{-1} - 8 \cdot 10^{-9} \text{ Om}^{-1} \cdot \text{ сm}^{-1}$ . При нагревании кристаллов *p*-типа проводимости в интервале температур 300–440 K происходил их отжиг, при этом проводимость уменьшалась. Вид спектров низкотемпературной (5–20 K) фотолюминесценции образцов указывает на их высокое структурное совершенство. Особенностью излучения кристаллов CdTe:Si является уменьшение интенсивности всех линий, которые образуются при участии доноров, по мере приближения к верхней части слитков. Полученные результаты указывают на то, что примесь Si, в отличие от Ge, Sn и Pb, не проявляет в CdTe компенсирующего и стабилизирующего действия.

PACS: 78.55.Et, 73.61.Ga

## 1. Введение

Теллурид кадмия является одним из наиболее перспективных материалов класса  $A^{II}B^{VI}$  для полупроводникового приборостроения. Свойства данного соединения в значительной мере определются взаимодействием между системами собственных и примесных дефектов, а также дефектно-примесных комплексов [1]. Для кристаллов CdTe, выращенных из жидкой фазы, типичными являются значительные концентрации фоновых примесей, ~ 10<sup>16</sup> см<sup>-3</sup>, которые могут находиться в электрически активном состоянии [2] и существенно влиять на свойства образцов при контролируемом легировании.

Одна из наиболее распространенных фоновых примесей в CdTe — кремний. Основным источником загрязнения данным элементом являются кварцевые ампулы, в которых выращивают кристаллы. Согласно данным работы [2], в кристаллах CdTe, выращенных методом Бриджмена из исходных компонент чистоты 5N и дополнительно очищенных стандартными методами, концентрация кремния достигает 1017 см-3. Однако информации о влиянии кремния на свойства CdTe в литературе очень мало. Исследуя свойства кристаллов CdTe:Si, выращенных из раствора-расплава в теллуре, авторы работы [3] не обнаружили корреляции между электрическими свойствами и содержанием примеси Si, если его концентрация не превышала 10<sup>18</sup> см<sup>-3</sup>. Легируя исходный материал одновременно литием и кремнием и изучая инфракрасную спектроскопию поглощения, авторы [4] отмечают, что атомы кремния могут размещаться в узлах кадмиевой подрешетки, входя в состав ассоциатов (Li<sub>Cd</sub>-Si<sub>Cd</sub>). С влиянием примеси Si авторы работы [5] связывают возникновение новой полосы излучения (0.88 мкм) в спектрах катодолюминесценции образцов CdTe:Si, отожженных в парах Te и Si\_2Te\_3.

Данная работа посвящена изучению электрических и фотолюминесцентных свойств монокристаллов CdTe:Si, легированных кремнием в разной концентрации, с целью установления возможной корреляции между параметрами образцов и количеством легирующего элемента.

#### 2. Экспериментальная часть

Кристаллы CdTe: Si выращивались методом Бриджмена. Легирующая примесь добавлялась в предварительно синтезированный материал, и ее концентрация в твердой фазе была в границах  $C_{\rm Si}^0 = 2 \cdot 10^{18} - 5 \cdot 10^{19} \, {\rm cm}^{-3}$ . Для выращивания использовали предварительно очищенные элементарные Cd и Te.

Образцы для исследований вырезались из участков слитков с разной приведенной длиной g ( $g = l/l_0$ , где  $l_0$  — общая длина слитка, l — расстояние от начала слитка до места, из которого изготавливался образец). Методика приготовления образцов и нанесения контактов описаны в [6]. Электрические измерения (электропроводность  $\sigma$ , коэффициент Холла  $R_H$ ) проводили на постоянном токе с использованием образцов в форме прямоугольных параллелепипедов, на боковые грани которых наносили две пары зондовых контактов. Измерения электрических характеристик проводили в интервале температур T = 80-440 К в направлении повышения и понижения температуры.

Спектры низкотемпературной фотолюминесценции (ФЛ) измерялись на сколотых поверхностях образцов с помощью монохроматора МДР-23, оснащенного охлаждаемым фотоумножителем ФЭУ-62. Для возбуждения

<sup>¶</sup> E-mail: p\_ebox@mail.ru

№ образца	Слиток	Концентрация примеси $C_{Si}^0$ , см <sup>-3</sup>	Приведенная длина $g = l/l_0$	Тип прово- димости	Удельная проводи- мость $\sigma$ , $\mathrm{Om}^{-1} \cdot \mathrm{cm}^{-1}$	Подвижность $\mu_H$ , $cm^2/B \cdot c$	Энергия актива- ции <i>E</i> , эВ
1 2	CT274	$2 \cdot 10^{18}$	0.20 0.46	n Инверсия	$2.0 \cdot 10^{-1} \\ 1.0 \cdot 10^{-9}$	960	0.01
3 4		c 10 <sup>18</sup>	0.81 0.33	р р	$7.9 \cdot 10^{-9}$ $4.1 \cdot 10^{-9}$	86	0.65
5	} 119-86(II)	$5 \cdot 10^{10}$	0.75	р р	$1.4 \cdot 10^{-7}$		
6 7 8	} 11У-86(III)	$1\cdot 10^{19}$	0.26 0.52	p n	$7.5 \cdot 10^{-8} \\ 1.9 \cdot 10^{-8} \\ 5.1 \cdot 10^{-4}$	53 840	0.51 0.78
8 9	$\int$ 11V-86(IV)	5 · 10 <sup>19</sup>	0.83	р n	$3.6 \cdot 10^{-3}$	05	0.05
10	f	2 10	0.61	п	$8.5\cdot 10^{-6}$		

Равновесные характеристики образцов CdTe: Si при 300 K

использовали He–Ne-лазер (50 мВт/см<sup>2</sup>). Образцы для ФЛ и электрических измерений вырезали из сопредельных областей шайб.

## 3. Результаты и обсуждения

Исходные образцы CdTe:Si были *n*- и *p*-типа с величиной удельной проводимости, изменявшейся в границах  $\sigma = 2 \cdot 10^{-1} - 8 \cdot 10^{-9}$  Om<sup>-1</sup> · см<sup>-1</sup>. Некоторые равновесные параметры исследуемых кристаллов приведены в таблице. Анализ представленных в таблице данных показывает, что на всех слитках наблюдается увеличение дырочной компоненты проводимости при приближении к верхней части кристаллов. Так, для слитков 11У-86(II) и 11У-86(III), в которых проводимость нижних частей — дырочная, концентрация носителей в конечных частях слитков возрастает. В случае электронной проводимости



**Рис. 1.** Температурные зависимости удельного сопротивления CdTe:Si (образец 6). Цифры (1-3) указывают последовательность измерений, а стрелки — направление изменения температуры.

происходит ее уменьшение в начале слитка (слиток 11У-86(IV)) или инверсия и переход к *p*-типу проводимости (слиток CT274) при продвижении в области с большей приведенной длиной *g*.

Учитывая то, что коэффициент распределения кремния в CdTe близок к единице [2], такое отличие в свойствах образцов, вырезанных из разных участков слитка, нельзя объяснить влиянием введенной примеси. Увеличение концентрации дырок в конечных областях кристаллов, а также проявление мелкого акцепторного уровня (энергия активации E = 0.05 эB, образец 8 см. таблицу) дают основания считать, что доминирующими дефектами в CdTe:Si, как и в нелегированном теллуриде кадмия, выращенном методом Бриджмена, являются вакансии кадмия ( $V_{Cd}$ ). Увеличение концентрации последних в конце слитка может быть обусловлено непосредственным контактом кристалла с паровой фазой.

Характерной особенностью кристаллов *p*-типа был их отжиг в процессе измерения температурных зависимостей удельного сопротивления  $\rho = f(T)$ , который приводил к уменьшению проводимости, причем амплитуда изменений была большей для более низкоомного материала. Проведение серии последовальных нагревов и охлаждений образцов дало возможность получить набор прямолинейных зависимостей  $\lg \rho = f(10^3/T)$  с разными углами наклона, т.е. с разной энергией активации E (рис. 1). Видно, что во время повторных измерений образец становился более высокоомным и, соответственно, возрастала глубина залегания уровня, определяющего проводимость.

На рис. 2 изображены спектры ФЛ образцов, вырезанных из разных участков слитка СТ274. Проанализируем в отдельности экситонную (1.58-1.6 эВ), краевую (1.5-1.57 эВ) и примесную (1.3-1.48 эВ) области спектра. Для всех образцов наиболее интенсивной является линия ( $A^0$ , X) с максимумом около 1.590 эВ, обусловленная аннигиляцией экситонов, локализованных на нейтральных акцепторах, которыми могут быть



**Рис. 2.** Спектры фотолюминесценции образцов 1 (*a*), 2 (*b*), 3 (*c*), вырезанных из разных частей слитка СТ274 (таблица). Спектры нормированы на интенсивность соответствующей линии ( $A^0$ , X). T = 5 K.

как фоновые примеси Cu<sub>Cd</sub>, так и вакансии кадмия [7]. В экситонной области спектра образцов 1,2 четко проявляются линии, вызванные рекомбинацией экситонов, связанных на нейтральных донорах, находящихся в основном ( $D^0$ , X) и возбужденных (a, b, c) состояниях, и на ионизованных донорах — ( $D^+$ , X) с энергией максимума  $h\nu \approx 1.592$  эВ. Кроме того, наблюдается небольшой пик около 1.591 эВ (G), который является типичным для CdTe, легированного Cl, и обусловлен экситонами, локализованными на акцепторах ( $V_{Cd}-2Cl_{Te}$ ) [8]. Малая полуширина экситонных линий, проявление полосы излучения свободных экситонов (FE), а также низкая интенсивность примесной ФЛ свидетельствуют о высоком качестве образцов.

Для образца 2, вырезанного из средней части слитка, характерно уменьшение относительной интенсивности линии ( $D^0$ , X). Для образца 3 эта линия практически исчезает. Вместе с тем наблюдаются две другие особенности: линии W (1.586 эВ) и С (1.584 эВ), которые связываются в литературе с экситонами, локализованными соответственно на комплексах ( $V_{Cd}$ -Cl<sub>Te</sub>) [8] и ( $V_{Cd}$ -In<sub>Cd</sub>) [9]. Проявление линий G, W и C в излучении исследуемых кристаллов может быть связано с тем, что хлор и индий входят в состав фоновых примесей в теллуриде кадмия [2].

Краевая люминесценция образцов 1 и 2 состоит из дублета линий, обозначенных на рис. 2 (*e*-A) и (D-A),

которые обусловлены соответственно излучательными переходами электронов из зоны проводимости и с доноргого уровня на акцепторный центр, и их LO-фононных повторений. Энергия ионизации акцептора, определенная из спектров ФЛ, составляет ~ 56 мэВ. Это хорошо согласуется с результатами работы [10], в которой показано, что акцептором, ответственным за краевую ФЛ в номинально нелегированном CdTe, является комплекс (V<sub>Cd</sub>-2D). При приближении к середине слитка (образец 2) интенсивность линии (D-A) уменьшается по отношению к интенивности линии (*e*-A) и в краевой ФЛ образца 3, вырезанного из верхней части слитка, наблюдается лишь линия (е-А), сдвинутая в коротковолновую область на ~ 2 мэВ. Этот вывод подтверждается исследованиями температурной зависимости краевой ФЛ (рис. 3). Видно, что для образца 1 повышение температуры предопределяет возрастание относительной интенсивности линии (е-А) и уменьшение интенсивности линии (D-A) вследствие термически стимулированного перехода электронов с донорного уровня в зону проводимости [11]. В то же время форма линии краевой ФЛ образца 3 не изменяется с температурой. Это свидетельствует о том, что данная линия не является суперпозицией двух близко расположенных полос, обусловленных переходами (e-A) и (D-A), а содержит только (e - A).



**Рис. 3.** Спектры краевой фотолюминесценции образцов 1 (a) и 3 (b) при 5 и 25 К.

Физика и техника полупроводников, 2006, том 40, вып. 2

Смещение полосы (е-А) в коротковолновую область спектра, пропорциональное концентрации примеси, было выявлено при исследовании низкотемпературной ФЛ кристаллов CdTe: Pb [12]. Этот результат авторы объясняют комплексной природой акцепторного дефекта  $(Pb_{Cd} - V_{Cd})$ . При увеличении концентрации легирующей примеси уменьшается расстояние между компонентами ассоциатов и соответственно возрастает величина энергии кулоновского взаимодействия. В случае кристаллов CdTe:Si сдвиг максимума линии (e-A) тоже указывает на комплексную природу акцепторного центра, но без участия примеси кремния. Действительно, поскольку коэффициент распределения кремния в CdTe  $k_{Si} \ge 1$  [2], концентрация примеси уменьшалась бы в направлении к концу слитка и максимум (е-А) соответственно перемещался бы в низкоэнергетическую область спектра. Наблюдаемое смещение максимума данной полосы ФЛ в нашем случае может объясняться тем, что в состав сложного акцептора, переходы на который формируют линию (e-A), входят неконтролируемые доноры, коэффициент распределения которых меньше 1 (In, Al, Cl) [1,2]. Кроме того, величина сдвига в случае CdTe: Pb большая сравнительно с теллуридом кадмия, легированным кремнием.

Люминесценция монокристаллов CdTe вблизи 1.4 эВ обусловлена рекомбинацией донорно-акцепторных пар (DAP), в которых акцепторами являются *A*-центры. Кроме того, в этой спектральной области может проявляться так называемая *Y*-линия с максимумом 1.477 эВ, которую связывают с рекомбинацией экситонов, локализованных на дислокациях [13–15]. Для образцов 1–3 по мере приближения к концу слитка интенсивность полосы DAP уменьшается, а интенсивность *Y*-линии, напротив, возрастает.

Сравнивая относительные интенсивности полос излучения разных образцов, можно заметить определенные закономерности их изменения вдоль оси слитка. Так, при переходе от нижней части кристалла к его вершине наблюдается уменьшение интенсивности всех линий ФЛ, связанных с участием доноров: экситонов, локализованных на нейтральных донорах, линии (D-A) в краевой области и полосы DAP около 1.4 эВ. Результаты фотолюминесцентных и электрических измерений хорошо согласуются между собой. Как видно из таблицы, в нижней части кристалла СТ274 есть большое количество мелких донорных дефектов (низкоомный *n*-тип). Поэтому понятна большая относительная интенсивность полос  $(D^0, X)$ , (D-A) и DAP в спектре ФЛ образца 1. В верхней части кристалла (р-тип) преобладают акцепторые дефекты и упомянутые линии излучения менее интенсивны или вообще отсутствуют.

Для образца 1, холловская подвижность электронов  $\mu_H$  в котором близка к максимально возможной, была оценена концентрация ионизованных центров  $N_i$  на основании анализа температурной зависимости  $\mu_H$  в области азотных температур. В учетом лишь двух механизмов рассеяния (на фононах и ионизованных центрах)

и при использовании формулы Брукса–Херинга [16] было получено  $N_i \approx 4 \cdot 10^{16}$  см<sup>-3</sup>. Поскольку концентрация атомов Si при  $C_{Si}^0 = 2 \cdot 10^{18}$  см<sup>-3</sup> и  $k_{Si} \ge 1$  должна значительно превышать концентрацию фоновых примесей, полученное значение  $N_i$  свидетельствует о том, что преобладающее количество кремния находится в электрически неактивной форме.

Полученные результаты исследований свойств кристаллов CdTe: Si показывают, что поведение кремния и других примесей электронов IV группы (Ge, Sn, Pb) в CdTe заметно различается. Кремний не проявляет в CdTe компенсирующего и стабилизирующего действия, как это происходит при легировании атомами Ge, Sn, Рь [17]. Характер изменений, которые наблюдаются при нагревании образцов CdTe: Si дырочного типа проводимости, близки к типичным для нелегированного материала [18]. Поскольку сопротивление кристаллов CdTe: Si изменялось в широких пределах (см. таблицу), говорить о компенсирующем действии примеси кремния нет оснований. Не исключена возможность получения материала с высоким сопротивлением из-за компенсирующего действия фоновых примесей донорного типа (In, Al, Cl) или собственных дефектов (Cd<sub>i</sub>, Te<sub>Cd</sub>).

Постепенное увеличение удельного сопротивления образцов при повторных измерениях может быть обусловлено генерацией дефектов донорного типа, которые приводят к возрастанию степени компенсации материала. Такими дефектами могут быть быстро диффундирующие атомы фоновых примесей I группы (Си или Ag), которые проявляют в CdTe амфотерное действие [1]. При повышении температуры возрастает их концентрация в междоузлиях согласно реакции:  $M_{Cd}^- \rightarrow M_i^+ + V_{Cd}^- + e^-$ , где M — атомы Cu или Ag.

#### 4. Заключение

Примесь кремния не проявляет в теллуриде кадмия компенсирующего и стабилизирующего действия, как это имеет место при легировании CdTe другими элементами IV группы (Ge, Sn, Pb). Изменения электрических свойств, которые наблюдаются при нагревании кристаллов CdTe: Si и образцов нелегированного теллурида кадмия, близки между собой. Равновесные и неравновесные процессы в исследуемых образцах зависят в основном от состояния системы собственных и примесных точечных дефектов и их комплексов, а также от степени структурного совершенства полупроводника.

## Список литературы

- K.R. Zanio. Semiconductors and Semimetals (N.Y.-San Francisco-London, 1978) v. 13, p. 235.
- [2] P. Rudolph, M. Mühlberg, M. Neubert, T. Boeck, P. Möck, L. Parthier, K. Jacobs. J. Cryst. Growth, 118, 204 (1992).
- [3] L. Chibani, M. Hage-Ali, J.P. Stoguert, J.M. Koebel, P. Siffert. Mater. Sci. Eng. B, 16, 202 (1993).

- [4] R. Zielińska-Purgal, J. Piwowarczyk, W. Nazarewich. Phys. Status Solidi B, 186, 355 (1994).
- [5] I.N. Odin, M.V. Chukichev, V.A. Ivanov, M.E. Rubina. Inorg. Mater., 37, 455 (2001).
- [6] A.V. Savitsky, O.A. Parfenyuk, M.I. Ilashchuk, P.M. Fochouk, N.D. Korbutyak. Semicond. Sci. Technol., 15, 263 (2000).
- [7] S.H. Song, J.F. Wang, M. Isshiki. J. Cryst. Growth, 257, 231 (2003).
- [8] H.-Y. Shin, C.-Y. Sun. J. Cryst. Growth, 186, 354 (1998).
- [9] S. Seto, K. Suzuki, V.N. Abastillas Jr., K. Inabe. J. Cryst. Growth, 214/215, 978 (2000).
- [10] H.-Y. Shin, C.-Y. Sun. Mater. Sci. Eng., B52, 78 (1998).
- [11] Д.В. Корбутяк, С.Г. Крилюк, Ю.В. Крюченко, Н.Д. Вахняк. ОПТ, 37, 27 (2002).
- [12] А.В. Савицкий, О.А. Парфенюк, М.И. Илашук, А.Й. Савчук, С.М. Чупыра. ФТП, 38, 516 (2004).
- [13] P.J. Dean, G.M. Williams, G. Blackmore. J. Phys. D, 17, 2291 (1984).
- [14] C. Onodera, T. Taguchi. J. Cryst. Growth, 101, 502 (1990).
- [15] S. Seto, A. Tanaka, F. Takeda, K. Matsuura. J. Cryst. Growth, 138, 346 (1994).
- [16] Физика и химия соединений А<sup>II</sup>В<sup>VI</sup>, под ред. С.А. Медведева (М., Мир, 1970).
- [17] A.V. Savitsky, M.I. Ilashchuk, O.A. Parfenyuk, K.S. Ulyanitsky, V.R. Burachek, R. Ciach, Z. Swiatek, Z. Kuznizki. Thin Sol. Films, 361, 203 (2000).
- [18] А.В. Савицкий, М.И. Ілащук. О.А. Парфенюк, К.С. Ульяницький, П.М. Фочук. УФЖ, 41, 82 (1996).

Редактор Л.В. Шаронова

# Electrical properties and the low-temperature photoluminescence of Si-doped CdTe single crystals

O.A. Parfenyuk, M.I. Ilaschuk, K.S. Ulyanitskii, P.M. Fochuk, O.M. Strilchuk\*, S.G. Krylyuk\*, D.V. Korbutyak\*

Yuri Fed'kovich Chernovtsy National University, 58012 Chernovtsy, Ukraine \* V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics National Academy of Sciences of Ukraine, 03028 Kiev, Ukraine